

Hochreiner Labor-Gasreiniger Für Inertgasatmosphäre Und Ultra-Saubere Prozessgase

Artikelnummer: KT-JH



Einführung

Entdecken Sie unseren hochreinen Labor-Gasreiniger, der für die kontinuierliche Bereitstellung von ultra-sauberem Inertgas entwickelt wurde. Durch die effektive Entfernung von Feuchtigkeit und Sauerstoff auf Werte im Sub-ppm-Bereich gewährleistet dieses System eine absolute Integrität der Atmosphäre für anspruchsvolle CVD-, Halbleitersynthese- und fortschrittliche metallurgische Forschungseinrichtungen.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Halbleiter- & Dünnschicht-Epitaxie	Liefert hochreines Argon- oder Stickstoffträgergas während der Waferverarbeitung direkt in CVD-, PECVD- und ALD-Kammern.	Verhindert Substratoxidation, minimiert Pinhole-Defekte und gewährleistet eine hohe Schichtgleichmäßigkeit über empfindliche atomare Schichten hinweg.
Thermische Verarbeitung unter Inertgasatmosphäre	Reinigt Schutzgasströme für Rohröfen, Vakuum-Atmosphärenöfen und Dental-Sinteranlagen zur Verarbeitung reaktiver Legierungen.	Eliminiert Zunderbildung und Entkohlung von Oberfläche auf Titan, Zirkonium und refraktären Superlegierungen bei Hochtemperaturprozessen.
F&E für Lithium- & Festkörperbatterien	Konditioniert Schutzatmosphären in Handschuhkästen, Pouch-Zell-Montagelinien und Elektrolyt-Formulierungsstationen.	Schützt feuchtigkeitsempfindliche Lithium-Metall-Anoden und Festelektrolyt-Chemien vor katastrophalem Feuchtigkeitsabbau.
Glasfaser- & Photovoltaik-Herstellung	Reinigt die Prozessatmosphäre beim Ziehen von Preformen, beim Silizium-Ingot-Guss und bei der Abscheidung passivierter Wafer-Kontaktschichten.	Verhindert Hydroxyl-Absorptionsbanden (OH) in Quarzglas und bewahrt die Ladungsträgerlebensdauer in Hocheffizienz-Solarzellen.
Additive Fertigung & 3D-Druck	Rezirkuliert und verfeinert Inertschutzgase in Baukammern für selektives Laserschmelzen (SLM) und Elektronenstrahlschmelzen (EBM).	Hält den Sauerstoffgehalt außergewöhnlich niedrig, um Spritzer, Porosität und Versprödung beim Drucken reaktiver Metalle zu verhindern.
Analytische Instrumenten-Trägergasversorgung	Bietet ultrastabile, feuchtigkeitsfreie Trägergasströme für Gaschromatographie (GC-MS), optische Emissionsspektrometrie (OES) und TGA.	Senkt das Grundrauschen, verhindert Säulenbluten, verlängert die Lebensdauer von Analysedetektoren und erhöht die quantitative Reproduzierbarkeit.
Katalyse & Nanomaterialsynthese	Liefert saubere Reaktionsatmosphären bei der Katalysatorreduktion, Kalzinierung und Hochdrucksynthese von Kohlenstoffnanoröhren (CNT).	Eliminiert die kompetitive Vergiftung aktiver Katalysatorzentren durch verbliebenen Sauerstoff und organische Feuchtigkeitsverunreinigungen.

Spezifikationsparameter	KT-JH-10	KT-JH-30	KT-JH-60	KT-JH-100
Artikelnummer	KT-JH-10	KT-JH-30	KT-JH-60	KT-JH-100
Kompatibilität gereinigter Gase	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2	Ar, N2, He, Kr, Ne, H2
Nenn-Durchflussmenge	10 L/min (0.6 m³/h)	30 L/min (1.8 m³/h)	60 L/min (3.6 m³/h)	100 L/min (6.0 m³/h)